

(11)Publication number:

11-014614

(43) Date of publication of application: 22.01.1999

(51)Int.CI.

G01N 30/60 G01N 27/62 G01N 30/24 G01N 30/72

(21)Application number: 09-165758

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing:

23.06.1997

(72)Inventor: HIRABAYASHI YUKIKO

HIRABAYASHI TSUDOI OKUMURA AKIHIKO

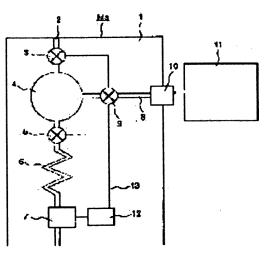
KOIZUMI HIDEAKI

(54) COMPACT ANALYZER AND MASS SPECTROGRAPH CONNECTED TO IT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a monitor device where time and labor for sampling a sample again is eliminated when performing a detailed analysis by monitoring multiple points.

SOLUTION: A device consists of a channel 2, an ion source 10, a separation part 6 for separating a mixture in a solution sample on the channel 2, 6 the detection part 7 of a separated substance concentration, the pool part 4 of a solution sample at the upstream side of the separation part 6, a channel 8 for connecting the pool part 4 and the ion source 10, fluid valves 3, 5, and 9, and a processor 12 on a substrate 1. When the detection part 7 detects the abnormal value in the concentration of the separated substance, the processor 12 switches fluid valves 3, 5, and 9 so that the solution sample can be stored at the pool part 4.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appear against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-14614

(43)公開日 平成11年(1999)1月22日

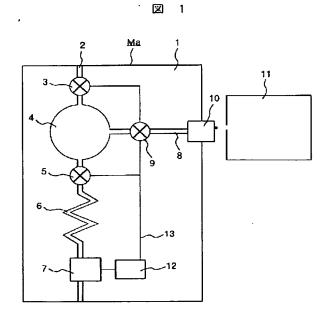
(51) Int. C1. GO1N 30/60 27/62 30/24 30/72	識別記 号	F I G01N 30/60 27/62 30/24 30/72	X A
		審査請求	未請求 請求項の数9 OL (全9頁)
(21)出願番号	特願平9-165758	(71)出願人	000005108 株式会社日立製作所
(22)出願日	平成9年(1997)6月23日	(72)発明者	東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 平林 由紀子 東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
		(72)発明者	平林 集 東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
		(72)発明者	奥村 昭彦 東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
		(74)代理人	弁理士 高橋 明夫 (外1名) 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】小型分析装置及びこの小型分析装置と結合する質量分析装置

(57)【要約】

【課題】 多点をモニターし、詳細な分析を行いたい場合は、再度、試料採取をする手間を省いたモニター装置を提供する。

【解決手段】基板1上に、流路2と、イオン源10と、流路2上に溶液試料中の混合物を分離する分離部6と、分離物質濃度の検出部7と、分離部6の上流側の溶液試料のプール部4と、プール部4とイオン源10を接続する流路8と、流体バルブ3、5、9と、プロセッサ12から構成し、検出部7が分離物質の濃度の異常値を検出すると、プロセッサ12が溶液試料をプール部4に溜めるように流体バルブ3、5、9を切り替えるようにしたものである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に、溶液試料が流れる一の試料流 路と、前記溶液試料中に存在する混合物を分離する分離 部と、前記分離部の上流側に前記溶液試料をプールする プール部と、前記分離物質の濃度を検出する検出部と、 イオン源と、前記プール部と前記イオン源を接続する他 の試料流路と、前記プール部近傍の一の試料流路および 他の試料流路に設けた複数の流体バルブと、これら各部 を制御する制御部とを備え、

前記検出部が前記分離物質の異常濃度値を検出しまたは 10 前記分離部もしくは検出部が停止するいずれかであると きは、前記複数の流体バルフが前記溶液試料を前記プー ル部にプールするように切り替わるように構成したこと を特徴とする小型分析装置。

【請求項2】 基板上に、溶液試料が流れる一の試料流 路と、前記溶液試料中に存在する混合物を分離する分離 部と、前記分離部の上流側に前記溶液試料をプールする プール部と、前記分離物質の濃度を検出する検出部と、 前記プール部と接続する他の試料流路と、前記他の試料 流路の端部には外部装置との接続部と、前記プール部近 20 傍の一の試料流路および他の試料流路に設けた複数の流 体バルブと、これら各部を制御する制御部とを備え、 前記検出部が前記分離物質の異常濃度値を検出しまたは 前記分離部もしくは検出部が停止するいずれかであると きは、前記複数の流体バルフが前記溶液試料を前記プー ル部にプールするように切り替わるように構成したこと を特徴とする小型分析装置。

【請求項3】 基板上に、溶液試料が流れる一の試料流 路と、前記一の試料流路に設けた溶液試料中に存在する する検出部と、イオン源と、前記分離部とイオン源を接 続する他の試料流路と、前記分離部の下流近傍の一の試 料流路および他の試料流路に設けた複数の流体バルブ と、これら各部を制御する制御部とを備え、

前記検出部が前記分離物質の異常濃度値を検出しまたは 前記分離部もしくは検出部が停止するいずれかであると きは、前記複数の流体バルフが前記分離物質を前記イオ ン源に導入するように切り替わるように構成したことを 特徴とする小型分析装置。

【請求項4】 請求項1、2記載のいずれかの小型分析 40 装置において、

溶液試料中に存在する混合物を分離する分離部を、前記 他の試料流路にも配設したこと特徴とする小型分析装 置。

【請求項5】 請求項1、2記載のいずれかの小型分析 装置において、

前記他の試料流路に、前記試料溶液を移送する移送手段 を配設したことを特徴とする小型分析装置。

【請求項6】 請求項1、2、4、5記載のいずれかの 小型分析装置において、前記プール部を、前記他の試料 50 に分析するためには溶液中の試料分子を気体状のイオン

流路に配設したことを特徴とする小型分析装置。

【請求項7】 請求項1、3、4、5、6記載のいずれ かの小型分析装置と結合できる接続部を具備したことを 特徴とする質量分析装置。

【請求項8】 請求項2記載の小型分析装置の他の試料 流路の外部装置の接続部と接続できる端部と、当該端部 に接続した分離部と、当該分離部に接続されたイオン源 とを、具備することを特徴とする質量分析装置。

【請求項9】 請求項1、2、3、4、5、6記載のい ずれかの小型分析装置と接続したことを特徴とする質量 分析装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、小型分析装置及び この小型分析装置に結合される質量分析装置に係り、溶 液中に存在する物質の濃度をモニターする小形分析装 置、特にシリコンまたは石英の基板上に試料の調整部、 分離部、検出部、イオン源等を配置した小型分析装置及 び質量分析装置に関するものである。特に、液体中に存 在する有害物質を常時分析する装置において、異常値を 検出した場合、迅速に質量分析法による精密分析を行う ことを可能にする小型分析装置と、前記小型分析装置と 接続可能な質量分析装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】キャピラリー電気泳動装置(以下、CE という) もしくは液体クロマトグラフ(以下、LCとい う) は、溶液中に存在する試料の分離では威力を発揮す るが、分離された試料の種類の同定、とくに、単品が入 手できない混合物については困難であった。一方、質量 混合物を分離する分離部と、前記分離物質の濃度を検出 30 分析計(以下、MSという)は、試料を高感度で同定す る有力な手段であるが、溶液中の試料の分離ができな

> 【0003】このため、水等の溶媒に溶解した複数の物 質を分離分析する場合、質量分析計にキャピラリー電気 泳動装置を結合させたキャピラリー電気泳動/質量分析 計(以下、CE/MSという)、または液体クロマトグ ラフを結合させた液体クロマトグラフ/質量分析計(以 下、LC/MSという)がそれぞれの特色を活かして一 般に使用されている。上記CE/MSについては、An alytical Chemistry, 60, 436-441 (1988) に記載されている。

> 【0004】上記CEについては、ガラス基板上に細い 溝を掘り電気泳動を行わせて混合試料を分離し、簡易に 同定する技術がAnalytical Chemist pp2637-2642 (1993) 65, に記載されている。前記CEは、小型、且つ移動可能な 簡易に使用できる分析装置であり、カセット型ともいう べきものであった。しかし、上記小型分析装置で分離・ 簡易に同定された試料を、必要がありさらにMSで詳細

10

3

に変換することが必要である。

【0005】上記気体状のイオンを変換する従来技術として、イオンスプレー法(Analytical Chemistry、第59巻(1987年)第2642項から第2646項)、エレクトロスプレー法(Jounal of Phycal Chemistry、第88巻(1984年)第4451頁から第4459頁)、大気圧化学イオン化法(Analytical Chemistry、第54巻(1982年)第143頁から第146頁)等が知られている。

【0006】最近、上記の方法とは別のイオン化法として、音速のガスにより試料溶液を噴霧するだけで効率よくイオンを生成させるソニックスプレー法が、(Analytical Chemistry, vol. 66, pp4457-4559(1994) またはAnalytical Chemistry, vol. 67, pp2878-2882(1995)、または特開平7-306193号公報に報告されている。この方法では、音速のガスの流れにより微細な帯電液滴が生成され、さらに溶媒分子が剥がされてイオンが生成すると考えられている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】上記Analytical Chemistry記載のガラス基板上に細い溝を穿設して泳動路とし、電気泳動を行わせて混合試料を分離し、同定する小型分析装置を用いて水質の汚染度等を多点でモニターしている場合に、その内、特定の個所で異常値を検出した場合に、質量分析装置により詳細な分析する場合、その検出点の試料を新たに採取し直し、当該質量分析装置に注入するという手間がかかるという問題点が生じた。上記の問題点を解決するためには、多点のモニター装置毎に高価な質量分析装置を設置しなければならず、経済的に高コストになるという問題点があった。

【0008】また、前記小型分析装置で、電源をストップしたり、修理したり、点検したりする場合には当該小型分析装置は停止させるため、その間、測定機能が中断するという問題点があつた。上記の如く、前記小型分析装置を簡易なカセット型として通常時には監視用として 40使用し、異常時にはMSを使用して詳細に分析するシステムを構成しても、上記ような不具合な問題点が生じていた。

【0009】本発明は、かかる従来技術の問題点を解決するためになされたもので、小型分析装置において、通常時と異常時では異なる機能を発揮させるようにし、詳細な分析値を得たい特定の個所で、新たに試料を採取し直す手間を省き、装置の電源ストップおよび修理、点検による機能の中断を防ぎ、低コストで多点のモニター監視および時間ロスがなくし、詳細な分析データが得られ50

る小型分析装置及びこの小型分析装置に接続される質量 分析装置を提供することをその目的とするものである。 【0010】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明に係る小型分析装置の構成は、基板上に、溶液試料が流れる一の試料流路と、前記溶液試料中に存在する混合物を分離する分離部と、前記分離部の上流側に前記溶液試料をプールするプール部と、前記プール部と、前記プール部と横出する検出部と、イオン源と、前記プール部と前記イオン源を接続する他の試料流路と、前記プール部近傍の一の試料流路および他の試料流路に設けた複数の流体バルブと、これら各部を制御する制御部とを備え、前記検出部が前記分離物質の異常濃度値を検出しまたは前記分離部もしくは検出部が停止するいずれかであるときは、前記複数の流体バルフが前記溶液試料を前記プール部にプールするように切り替わるように構成したことを特徴とするものである。

【0011】本発明に係る小型分析装置の他の構成は、 基板上に、溶液試料が流れる一の試料流路と、前記溶液 試料中に存在する混合物を分離する分離部と、前記分離 部の上流側に前記溶液試料をプールするプール部と、前 記分離物質の濃度を検出する検出部と、前記プール部と 外部装置を接続する他の試料流路と、前記プール部近傍 の一の試料流路および他の試料流路に設けた複数の流体 バルブと、これら各部を制御する制御部とを備え、前記 検出部が前記分離物質の異常濃度値を検出しまたは前記 分離部もしくは検出部が停止するいずれかであるとき は、前記複数の流体バルフが前記溶液試料を前記プール 部にプールするように切り替わるように構成したことを 特徴とするものである。

【0012】本発明に係る小型分析装置のさらに他の構成は、基板上に、溶液試料が流れる一の試料流路と、前記溶液試料中に存在する混合物を分離する分離部と、前記分離物質の濃度を検出する検出部と、イオン源と、前記分離部とイオン源を接続する他の試料流路と、前記分離部の近傍の一の試料流路および他の試料流路に設けた複数の流体バルブと、これら各部を制御する制御部とを備え、前記検出部が前記分離物質の異常濃度値を検出しまたは前記分離部もしくは検出部が停止するいずれかであるときは、前記複数の流体バルフが前記分離物質を前記イオン源に導入するように切り替わるように構成したことを特徴とするものである。

【0013】前記記載のいずれかの小型分析装置において、前記他の試料流路に、前記試料溶液を移送する移送手段を配設したことを特徴とするものである。前記記載のいずれかの小型分析装置において、前記溶液試料中に存在する混合物を分離する分離部を、前記他の試料流路にも配設したこと特徴とするものである。前記記載のいずれかの小型分析装置において、前記プール部を、前記他の試料流路に配設したことを特徴とするものである。

40

【0014】本発明に係る質量分析装置の構成は、前記 記載のいずれかの小型分析装置と結合できる接続部を具 備したことを特徴とするものである。本発明に係る質量 分析装置の他の構成は、前記記載の小型分析装置の他の 試料流路の外部装置の接続部と接続できる接続部と、当 該接続部に接続した分離部と当該分離部に接続されたイ オン源とを具備することを特徴とするものである。本発 明に係る質量分析装置のさらに他の構成は、前記記載の いずれかの小型分析装置と接続したことを特徴とするも のである。

[0015]

【発明の実施の形態】まず、本発明に係る小型分析装置 (以下、モニター装置という) 及びこれに結合された質 量分析装置の構成の概略を説明する。分離作用が行われ るモニター装置の基板上の試料溶液が流れる流路の一部 に溶液をプールするプール部を設け、異常値もしくはモ ニター装置の停止信号に連動して試料溶液をプールさせ る。さらに、上記基板上にイオン源もしくは外部のイオ ン源との接続部を設け、前記プール部と前記イオン源も しくは前記接続部とを接続させる。そして、基板を質量 20 分析装置にセットし結合させると、前記プール部から前 記イオン源もしくは前記プール部から外部のイオン源に 試料溶液を流し、さらに質量分析装置に導入され分析す る。

【0016】したがつて、モニター装置と質量分析装置 を接続して使用することにより、モニター装置が異常を 検知したりもしくはモニター装置を停止したりする場合 に、前記試料溶液の流路を切り替え、当該試料溶液をモ ニター装置から質量分析装置に導入することにより、質 細な分析ができることになる。

【0017】 [実施の形態 1] 図1は、本発明に係る モニター装置及びこれに結合される質量分析装置の構成 を示すブロック図である。本実施の形態においては、モ ニター装置にイオン源が設けられている場合について説 明する。図中、Maは、モニター装置、1は、前記モニ ター装置を構成する基板、2は試料溶液導入用流路、3 はプール部入口のバルブ、4は試料溶液用プール部、5 は分離部入口のバルブ、6は試料溶液の分離部、7は分 離成分の検出部、8は試料溶液のイオン源導入用流路、 9はプール部出口のバルブ、10はイオン源、11は質 量分析装置、12は制御用プロセッサ、13は制御用プ ロセッサから各部への信号線である。

【0018】混合試料溶液は、基板1上に穿設された試 料溶液導入用流路2を通ってバルブ3を介してプール部 4に導入され、さらにバルブ5を介して分離部6に導入 されて、成分毎に分離され、検出部7により濃度を検出 される。また、前記プール部4からは、別の試料溶液導 入用流路8が穿設されており、当該流路8により前記プ

ている。

【0019】前記分離部6で分離された試料溶液を検出 部7で試料濃度をモニターしている間は、前記バルブ 3、5が開かれ、バルブ9が閉じられている。前記検出 部7で検出された数値は制御用プロセッサ12に送られ る。そして、前記数値が、予め設定していた数値を超え た場合、当該制御用プロセッサ12から前記バルブ5、 9に信号線13を通じて閉信号が送られ、バルブ5、9 が閉じられて試料溶液をプール部4に蓄えられる。

【0020】そののち、前記基板1を質量分析装置11 の所定の部位に付設した接続部と接続されるようにセッ トすると、前記制御用プロセッサ12から前記バルブ9 に信号が送られ開となり、前記プール部4の試料溶液が イオン源10に導入される。このイオン源10では試料 溶液のイオン化がなされる。このイオン化された試料 は、質量分析装置11により質量分析される。このよう にして、異常を検知したら直ちにモニター装置を構成し ている基板 1 を質量分析装置の所定の部位にセットすれ ば、迅速、且つ詳細な分析を行うことができる。

【0021】前記プロセッサ12は、モニター装置の停 止信号が出力されたときに、バルブ3、5を閉じる信号 を送り、プール部4に試料溶液を蓄えるようにしても差 し支えない。このように構成すると、例えば上記構成の モニター装置を家庭用浄水器等に取り付けた場合、前記 モニター装置内をクリーニングするための定期的な交換 でモニターを取り外したときに、試料も採取することが できるため、定期交換毎に詳細な分析が簡便に行えるよ うになるというメリットがある。さらにまた、前記カセ ット化したモニター装置を、各家庭用浄水器等に移動手 量分析装置用の試料を別に採取することなく、迅速に詳 30 段、例えばキャスタ付き台車に着脱自在に固定して、移 動して取り付けるようにしても差し支えない。

> 【0022】前記検出器7として、化学センサ、または 光吸収量を計測するための光検出器、または粒子数計測 器を用いてもよい。分離部6の分離方法として細管の両 端に電圧を印加して分離するCE法を用いても差し支え ない。基板1上または基板1外に警報器を設け、異常値 を検知したときに制御用プロセッサ12から警報器に信 号を送って警報音を鳴らしても差し支えない。また、前 記モニター装置が設置してある場所の上流または下流に 設けられた制御部に信号を送り、流れを停止させて差し 支えない。

> 【0023】 [実施の形態 2] 図2を参照して、本発 明に係るモニター装置及び質量分析装置の他の実施の形 態を説明する。図2は、本発明に係るモニター装置及び 質量分析装置の他の実施の形態を示すブロック図であ る。図中、図1と同一符号は、図1の同一の機能、構成 であるので、再度の説明を省略し、新たな符号のみ説明 する。14は、試料溶液移送用ポンプである。

【0024】本実施形態のモニター装置Mbでは、図1 ール部4とイオン源10とがバルブ9を介して連結され 50 の〔実施の形態 1〕のモニター装置Maとほぼ同様の

構成であるが、基板1に穿設されたプール部4からイオ ン源10間の流路8上のバルブ9の後段に、試料溶液移 送用ポンプ14を配設した点が相違する。前記移送用ポ ンプ14は、モニター装置が質量分析装置11に付設さ れた所定の接続部位に設置されると、制御用プロセッサ 12によつて試料溶液の送液が開始されるように起動運 転される。

【0025】前記移送用ポンプ14の運転制御は、図示 しないが簡単なマイクロスイッチをふくむ制御機構を質 量分析装置11に設けても行うようにしてもよいし、制 10 御用プロセッサ12から図示しないが信号線13を前記 ポンプ14にも配線し、当該制御用プロセッサ12から 送液信号を送って運転しても差し支えない。前記ポンプ 14には、ダイアフラム型ポンプ、電気浸透ポンプ等を 用いることができる。本実施の形態では、前記プール部 4から流路8を介してイオン源10へ試料溶液が自然流 下のみで移送困難な場合に有効となる。

【0026】 [実施の形態 3] 図3を参照して、本発 明に係るモニター装置及び質量分析装置のさらに他の実 施の形態を説明する。図3は、本発明に係るモニター装 20 置及び質量分析装置のさらに他の実施の形態を示すブロ ック図である。図中、図1と同一符号は、図1の同一の 機能、構成であるので、再度の説明を省略し、新たな符 号のみ説明する。15は、分離部である。

【0027】本実施形態に係るモニター装置Mcでは、 図1の〔実施の形態 1〕のモニター装置Maとほぼ同 様の構成であるが、基板1に穿設されたプール部4から イオン源10間の流路8上のバルブ9の後段にも分離部 15を配設した点が大きく相違する。前記分離部15と しては、例えば、細管の両端に電圧を印加して分離する CEが用いられる。モニター装置Mcが、質量分析装置 11の所定の場所に接続、且つ設置されたのち、バルブ 9が開かれ、プール部4に蓄えられた試料溶液は分離部 15に導入される。そこで成分毎に分離され、イオン源 10でイオン化され、質量分析装置11で分析される。 上記構成のモニター装置Mcは、プール部4からの試料 溶液を分離されてイオン源10へ導入することができ

【0028】 [実施の形態 4] 図4を参照して、本発 明に係るモニター装置及び質量分析装置のさらに他の実 40 施の形態を説明する。図4は、本発明に係るモニター装 置及び質量分析装置のさらに他の実施の形態を示すブロ ック図である。図中、図1と同一符号は、図1の同一の 機能、構成であるので、再度の説明を省略し、新たな符 号のみ説明する。16はモニター装置Mdに設けた外部 との接続部、17はモニター装置の外部接続部16と接 続されるLC部の接続部、18a、bは試料溶液導入 管、19はLCである。

【0029】図4の本実施形態モニター装置Mdでは、

ン源10の取り除き、その代わりに外部接続部16が基 板1上に設置されている場合を示すものである。また、 外部装置は、接続部17と、当該接続部17に続く試料 溶液導入管18aと、当該試料溶液導入管18aに結合 されているLCと、当該LCに結合されているイオン源 10と、当該イオン源10に接続可能な質量分析計11 とで構成されている。前記接続部16は、前記試料溶液 導入管18aの先端部に設けられている接続部17と連 結できるようになつている。

【0030】制御用プロセッサ12が異常もしくは停止 信号を検知した場合、バルブ5、9に信号線13を通じ て閉信号を送り、バルブ5、9が閉じられてバルブ3か らの試料溶液をプール部4に蓄えられる。そののち、基 板1の外部接続部16と、LC部の接続部17が接続さ れると、前記プロセッサ12からバルブ3に閉信号、バ ルブ9に開信号が送られ、試料溶液が流路8から接続部 16、17を介して導入管18aに導入される。

【0031】さらに、前記試料溶液が前記導入管18a からLC19に導入されて成分毎に分離され、イオン源 10でイオン化される。さらに、質量分析装置11を接 続すると、前記試料溶液が質量分析される。前記LCの 代わりに、CEを用いても差し支えない。また、LC、 CEのような分離手段を用いずに、直接イオン源10に 試料を導入しても差し支えない。さらに、前記バルブ9 と前記基板1の接続部16の間の流路に送液用ポンプを 設置しても差し支えない。また、バルブ9と接続部16 の間の流路に分離部を設けても差し支えない。

【0032】 [実施の形態 5] 図5を参照して、本発 明に係るモニター装置及び質量分析装置のさらに他の実 施の形態を説明する。図5は、本発明に係るモニター装 置及び質量分析装置のさらに他の実施の形態を示すブロ ック図である。図中、図1と同一符号は、図1の同一の 機能、構成であるので、再度の説明を省略する。

【0033】図5に示す本実施形態のモニター装置Me では、図1の〔実施の形態 1〕のモニター装置Maと ほぼ同様の構成であるが、プール部4を試料導入流路2 に配設したのではなく、イオン源10の上流側の試料流 路2より分岐させた試料流路8上に設けたものである。

【0034】この場合、プール部4より上流側の試料流 路8上にバルブ3を移設させるものである。また、バル ブ5は前記試料流路2と試料流路8の分岐部分より下流 側の試料流路2上に配設する。試料溶液は、基板1上に 穿設された試料導入流路2、バルブ5を通ってに導入さ れ、さらに分離部6に導入されて、成分毎に分離され、 検出部7により濃度を検出される。検出部7では、試料 濃度をモニターしている間は、バルブ5が開かれ、バル ブ3及び9は閉じられた状態になつている。

【0035】前記検出部7から制御用プロセッサ12に 送られた数値が予め設定していた数値を超えた場合、バ 図1の [実施の形態 1] のモニター装置Maからイオ 50 ルブ3、5、9に信号線13を通じて信号が送られ、バ ルブ5が閉じられてバルブ3が開き、試料溶液をプール部4に蓄えられるる。そののち、基板1が質量分析装置11に付設した所定の設置部分にセツトされて接続されるど、前記制御用プロセッサ12から前記バルブ9に信号が送られ開となり、試料溶液がイオン源10に導入される。前記イオン源10でイオン化された試料は、質量分析装置11に導入され、質量分析される。上記において、バルブ9とイオン源10の間の試料導入流路に送液用ポンプを設置しても差し支えない。また、前記バルブ9とイオン源10の間の流路に分離部を設けても差し支 10 えない。

【0036】また、図4の〔実施の形態 4〕のように、イオン源10を除去して代わりに接続部16を設置し、基板1の外部に液体クロマトグラフ19及びイオン源10を設置しても差し支えない。さらに、基板1上または基板1の外部に警報器を設け、異常値を検知したときに前記プロセッサ12から警報器に信号を送って警報音を鳴らしても差し支えない。また、警報音を鳴らす代わりに、モニター装置が設置してある場所の上流または下流に設けられた制御部に信号を送り、流れを停止させ 20 ても差し支えない。

【0037】 〔実施の形態 6〕図6を参照して、本発明に係るモニター装置及び質量分析装置のさらに他の実施の形態を説明する。図6は、本発明に係るモニター装置及び質量分析装置のさらに他の実施の形態を示すブロック図である。図中、図1と同一符号は、図1の同一の機能、構成であるので、再度の説明を省略する。

【0038】図6に示す本実施形態のモニター装置Mfでは、図1の〔実施の形態 1〕のモニター装置Maと原則的には同様の構成であるが、前記溶液入口に接続される流路2に分離部6を設け、さらに、プール部4を除いて前記モニター装置Mfと質量分析装置11との接続を簡潔、且つ物理的に近くに設置し、常時連結するして用いる場合に好適な例を示すものである。前記流路2に導入された試料溶液は、分離部6で分離され、検出器7で濃度を検出される。異常が検知されていない通常のモニター時では、バルブ9は閉じられ、バルブ20が開かれており、試料溶液は検出器7へと流れる。

【0039】前記検出部7から制御用プロセッサ12に送られた数値が予め設定していた数値を超えた場合、バ40ルブ9、20に信号線13を通じて信号が送られ、バルブ9が開き、バルブ20が閉じられて、試料溶液が試料導入流路8に流れ、さらにイオン源10に送られてイオン化され、そののち、質量分析装置11により分析される。前記の如く、モニター装置と質量分析装置が常時連結されている場合は、プール部を必要とせず、流路を切り替えるだけで迅速に詳細な分析ができるようになる。また、この場合、前記バルブ9とイオン源10の間の流路には、試料溶液移送用のポンプを設置しても差し支えない。50

【0040】また、図4の〔実施の形態 4〕のように、イオン源10の代わりに接続部16を設置し、基板1の外部にLC19及びイオン源10を設置してもよい。さらに、基板上または基板の外部に警報器を設け、異常値を検知したときにプロセッサ12から警報器に信号を送って警報音を鳴らしても差し支えない。または、モニター装置が設置してある場所の上流または下流に設けられた制御部に信号を送り、流れを停止させても差し支えない。

【0041】 [実施の形態 7] 図7、8を参照して、本発明に係るモニター装置のさらに他の実施の形態を説明する。図7は、本発明の一実施例に係るモニター装置における試料導入流路に沿う断面図、図8は、図7のモニター装置を他の試料導入流路に沿う断面図である。図中、図1と同一符号は、図1の同一の機能、構成であるので、再度の説明を省略する。

【0042】図7には、モニター装置Mgの試料導入流路8に沿った断面図である。本実施形態では、試料導入流路は基板1の内部に構成されている。試料導入流路8の先端にはキャピラリー21が接続されており、前記キャピラリー21の先端部は、イオン源10のオリフィス22に挿入されている。前記キャピラリー21の先端は、オリフィス22の開口部から約-0.25~1.0mm突出させる。前記イオン源10の上部に設けられたガス管接続部23には、ガスが供給されるガス管が接続され、イオン源10にガスを供給する。

【0043】前記イオン源10に導入されたガスは、キャピラリー21の外周部に沿って流れ、前記キャピラリー21の先端部が挿入されたオリフィス22から大気中に約200m/s以上のF/Sで噴出させる。ここでは、ガスの標準状態(20℃、1気圧)換算における流量をF、前記キャピラリー21の先端近傍の中心軸にほぼ直交する面上において、前記キャピラリー21と前記オリフィス22の間の空間がほぼ最小となる面積をSとしている。

【0044】前記ガスには、例えば窒素、アルゴン、酸素、空気等を用いる。キャピラリー21に導入された試料溶液は、例えばソニックスプレー(Sonic Spray)法では、前記キャピラリー21の先端部に沿って噴出するガスにより噴霧され、微小液滴の他に試料分子の気体状の擬似分子イオンが生成させる。また、ソニックスプレー法を用いたイオン源の代わりに、イオンスプレー法、またはエレクトロスプレー法、または大気圧化学イオン化法を用いたイオン源を設置しても差し支えない。

【0045】図8は、図7のモニター装置を試料導入流路2に沿った断面図である。図示するように、取水口24から導入された試料溶液は、流路2、プール部4、バルブ5、分離部7を通って検出部7で測定された後、排50水口25から排出される。

【0046】 [実施の形態 8] 図9を参照して、本発 明に係るモニター装置のさらに他の実施の形態を説明す る。図9は、本発明のさらに他の実施の形態に係るモニ ター装置の断面図である。図中、図1と同一符号は、図 1の同一の機能、構成であるので、再度の説明を省略す る。図9は、本発明のさらに他の実施の形態に係るモニ ター装置における試料導入流路に沿った断面図である。 この場合、モニター装置Mhにおいて試料導入流路8 は、基板1の表面に構成されており、ガラス板26を基 板1に重ねることによって、当該基板1上に設けられた 10 当該試料導入流路8は閉構造となつている。

【0047】図10は、図9のモニター装置における他 の試料導入流路に沿った断面図である。 前記基板1と ガラス板26の間に構成される取水口24から導入され た試料溶液は、流路2、バルブ3、プール部4、バルブ 5、分離部6を通って検出部7で測定された後、排水口 25から排出される。

[0048]

【発明の効果】以上、詳細に説明した如く、本発明の構 成によれば、異常値またはモニター装置の修理、点検等 20 の停止に連動して試料溶液が、当該モニター装置内のプ ール部にプールされるので、質量分析用の試料を別に採 取する必要がない。そして、モニター装置を質量分析装 置に接続すると、プール部からイオン源に溶液が流れ、 さらに、質量分析装置に導入され分析されるので、簡便 に詳細な分析を行うことができるという効果がある。こ のようにすると、例えば本発明のモニター装置を家庭用 浄水器に取り付けた場合、モニター内をクリーニングす るための定期的な交換でモニターを取り外したときに、 試料を採取して回収できるため、定期交換毎に詳細な分 30 離部、16…接続部、17…接続部、18a、18b… 析が簡便に行えるようになるという効果がある。また、 モニター装置を多箇所に、質量分析装置を一個所に設置 することにより、多点のモニター監視ができるという効 果がある。また、モニター装置と質量分析装置を接続し て設置している場合には、モニター装置が異常を検知し たら、試料の流路を切り替え、試料をイオン源から質量

分析装置に導入することにより、質量分析用の試料を別 に採取することなく、迅速な分析ができるという効果が ある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るモニター装置及びこれに結合され る質量分析装置の構成を示すブロック図である。

【図2】本発明に係るモニター装置及び質量分析装置の 他の実施の形態を示すブロック図である。

【図3】発明に係るモニター装置及び質量分析装置のさ らに他の実施の形態を示すブロック図である。

【図4】本発明に係るモニター装置及び質量分析装置の さらに他の実施の形態を示すブロック図である。

【図5】本発明に係るモニター装置及び質量分析装置の さらに他の実施の形態を示すブロック図である。

【図6】本発明に係るモニター装置及び質量分析装置の さらに他の実施の形態を示すブロック図である。

【図7】本発明の一実施例に係るモニター装置における 試料導入流路に沿う断面図である。

【図8】図7のモニター装置を他の試料導入流路に沿う 断面図である。

【図9】本発明のさらに他の実施の形態に係るモニター 装置の断面図である。

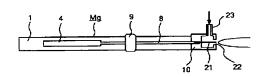
【図10】図9のモニター装置における他の試料導入流 路に沿った断面図である。

【符号の説明】

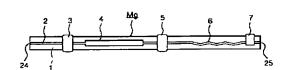
1…基板、2…流路、3…バルブ、4…プール部、5… バルブ、6…分離部、7…検出部、8…流路、9…バル ブ、10…イオン源、11…質量分析装置、12…制御 用プロセッサ、13…信号線、14…ポンプ、15…分 導入管、19…液体クロマトグラフ、20…バルブ、2 1…キャピラリー、22…オリフィス、23…ガス管接 続部、24…取水口、25…排水口、26…ガラス板、 Ma、Mb、Mc、Md、Me、Mf、Mg、Mh…モ ニター装置

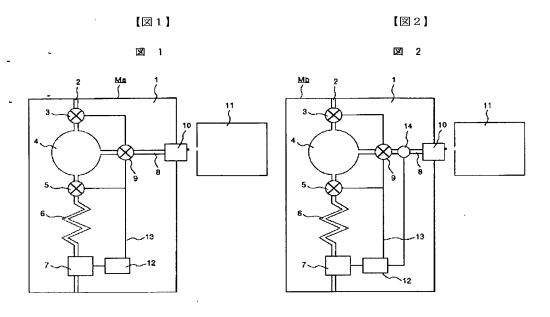
【図7】

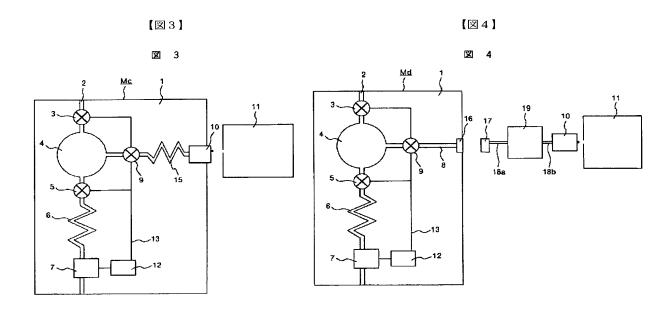
図 7

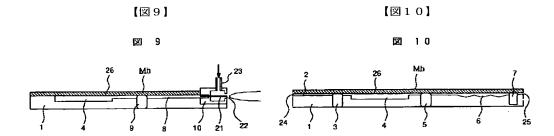


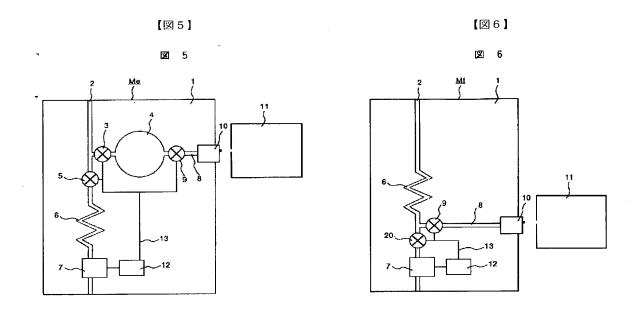
【図8】











フロントページの続き

(72)発明者 小泉 英明

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内